

รายการอ้างอิง

- [1] Liu, B., et al. Air-bearing design towards highly stable head-disk interface at ultralow flying height. IEEE Transactions on Magnetics, Vol 43, No.2 (2007): 715-720.
- [2] Lee, S-C., and Strom, BD. Characterization of thermally actuated pole tip protrusion for head-media spacing adjustment in hard disk drives. ASME Transaction Journal of Tribology, Vol.130, issue 2 (2008): 022001-022006.
- [3] Hua, W., et al. Contact recording review. Microsystem Technologies, Vol 16, No4 (2010): 493–503.
- [4] Vakis, Al. Polycarpou AA Optimization of the thermal fly-height control slider geometry for Tbit/in² recording. Microsystem Technologies, Vol 16, Issue 6 (2010): 1021-1034.
- [5] Liu, X., Clegg, W., and Liu, B. Polarisation interferometry flying height testing. Optical & Laser Technology, Vol 37, Issue 1 (2004): 21-27.
- [6] Liu, X., Clegg, W., Liu, B., and Chong, C. Improved Intensity Interferometry Method for measuring Head-disk spacing down contact. IEEE Transaction on Magnetics, Vol 36, No 5 (2000): 2674-2676.
- [7] Umehara, M., and Sato, M. Measuring apparatus of flying height of magnetic head. US Patent 6,246,475 (1994).
- [8] วิกีพีเดีย. ฮาร์ดดิสก์ [ออนไลน์] 2009. แหล่งที่มา:
<http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=history> [2010, March 20].

- [9] KEPCIL. Hard disk basics [online] 2010. Available from:
<http://keppanet.netfirms.com/keppanet/harddisk/hdinside.htm> [2010, March 20].
- [10] Talke lab. Head/Disk interface research [online] 2009. Available from:
<http://talkelab.ucsd.edu/head-disk/> [2010, March 20].
- [11] Buycoms. Harddisk [Online] 2009. Available from:
<http://www.buycoms.com/buyersguide/harddisk/index.asp> [2010, March 20].
- [12] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ฮาร์ดดิสก์ [ออนไลน์] แหล่งที่มา:
<http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/hdisk.htm> [2010, March 20].
- [13] Liu, X., Clegg, W., and Liu, B. Ultra low head–disk spacing measurement using dual beam polarisation interferometry. Optics & Laser Technology, Vol 32, Issue 4 (2000): 287-291.
- [14] Zhu, Y. Flying height measurement considering the effects of the slider-disk interaction. IEEE Transaction on Magnetics, Vol 36, No 5 (2000): 2677-2679.
- [15] KLA-Tencor Corporation. Dynamic Flying Height Tester Operation Manual. San Diago: KLA-Tencor, 2002 (Unpublished Manuscript).
- [16] Sciner.co. Fused silica [online] 2007. Available from:
<http://www.sciner.com/Opticsland/FS.htm> [2010, March 24].
- [17] Red optronic.co. BK7 glass [online] 2010. Available from:
<http://www.redoptronics.com/Bk7-optical-material.html> [2010, March 24].
- [18] Wikipedia. Fused quartz [Online] 2010. Available from:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fused_quartz [2010, March 24].
- [19] Wikipedia. Sapphire [Online] 2010. Available from:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Sapphire> [2010, March 24].

- [20] Hainsworth, S.V., and Uhure, N.J. Diamond like carbon coatings for tribology: production techniques, characterization method and application. International Materials Reviews, Vol 52, No 3 (2007): 153-174.
- [21] Wikipedia. Zinc oxide [Online] 2010. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_oxide [2010, March 25].
- [22] Wikipedia. Silicon nitride [Online] 2010. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_nitride [2010, March 25].
- [23] OHARA Corp. GD-FHT [Online] . Available from: <http://www.oharacorp.com/gdf.html> [2010, March 25].
- [24] Wikipedia. Fused quartz [Online] 2010. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Fused_quartz [2010, March 25].
- [25] KYOCERA. Crystal [Online] 2010. Available from: <http://americas.kyocera.com/kicc/industrial/crystal.html> [2010, March 25].
- [26] Bhushan ,B. Chemical, mechanical and tribological characterization of ultra-thin and hard amorphous carbon coatings as thin as 3.5 nm: recent developments. Diamond and Related Material, Vol 8, Issue 11 (1999): 1985-2015.
- [27] Brushan, B., Gupta, B.K., Michael, H., and Azarian. Nanoindentation, microscratch, friction, and wear studies of coatings for contact recording applications. Wear, Vol 181-183, part 2 (1995): 743-758.
- [28] Navamatha, R., et al. A nanoindentation study of the mechanical properties of ZnO thin films on (0 0 0 1) sapphire. Applied Surface Science, Vol 253, Issue 2 (2006): 464-467.
- [29] Beck, U., Smith, D.T., Reiners, G., and Dapkunas, S.J. Mechanical properties of SiO₂ and Si₃N₄ coatings: a BAM/NIST co-operative project. Thin Solid Films, Vol 332, Issue 1-2 (1998): 164-171.

- [30] J.A.Woollam.co. Ellipsometry tutorial [Online] 2010. Available from:
http://www.jawoollam.com/tutorial_1.html [2009, June 30].
- [31] JML optical industry. Introduction to coating [Online] 2010. Available from:
<http://www.jmloptical.com/pages/coatings.aspx> [2010, March 30].
- [32] Fujiwara, H. 2007. Spectroscopic Ellipsometry Principle and Application. John Wiley & Sons.
- [33] Tompkins, H.G., and William, A. 1999. Spectroscopic Ellipsometry and reflectometry. John Wiley & Sons.
- [34] Robertson, J. Diamond-like amorphous carbon. Materials Science and Engineering: R: Reports, Vol 37, Issues 4-6 (2002): 129–281.
- [35] Erdemir, A., and Donnet, C. Tribology of diamond-like carbon films: recent progress and future prospects. Journal of Physics D: Apply Physics, Vol 39, No 18 (2006): R311–R327.
- [36] Rymuza, Z. Control tribological and mechanical properties of MEMS surfaces. Microsystem Technologies, Vol 5, No 4 (1999): 173–180.
- [37] Luo, JK., et al. Diamond and diamond-like carbon MEMS. Journal of Micromechanics Microengineering, Vol 17, No 7 (2007): S147-S163.
- [38] Bhushan, B., and Koinkar, V.N. Microscale mechanical and tribological characterization of hard amorphous carbon coatings as thin as 5 nm for magnetic disks. Surface Coating Technology, Vol 76-77, Part 2 (1995): 655-669.
- [39] Sundararajan S., and Bhushan B. Micro/nanotribology of ultra-thin hard amorphous carbon coatings using atomic force/friction force microscopy. Wear, Volume 225, Part 1 (1999): 678-689.

- [40] Takai, O., Tajima, N., Saze, H., and Sugimura, H. Nanoindentation studies on amorphous carbon nitride thin films prepared by shielded arc ion plating. Surface and Coatings Technologies, Vol 142 (2001): 719-723.
- [41] Daniels, BK., Brown, DW., and Kimock, FM. Friction and wear performance of diamond-like carbon, boron carbide, and titanium carbide coatings against glass. Journal of Materials Research, Vol 12, Issue 9 (1997): 2485-2492.
- [42] University of Nebraska-Lincoln. Nanoindenter probes [Online] 2010. Available from: <http://www.engineering.unl.edu/research/bm3/Nanoindenter.shtml#details> [2010, July 25].
- [43] Lacey, C. Method and apparatus to calibrate intensity and determine fringe order for interferometric measurement of small spacing. US Patent 5,280,340 (1991).

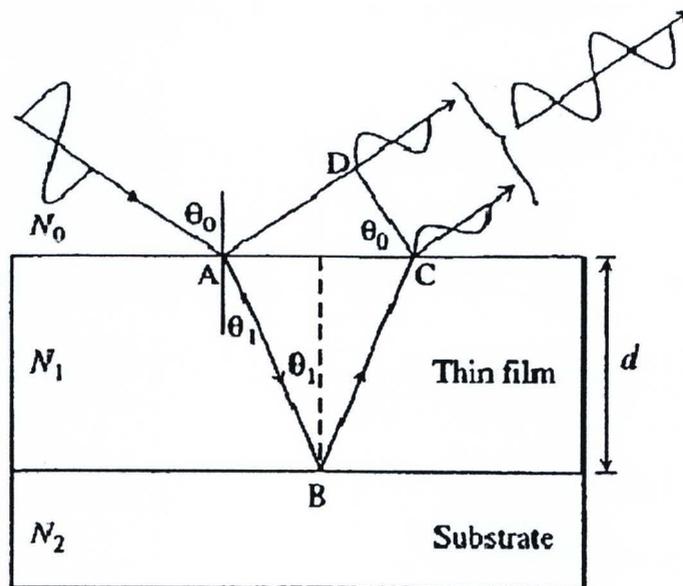
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การคำนวณการแทรกสอดของแสงในฟิล์มบาง

ก.1 ฟิล์มบางบน Substrate

รูปที่ ก.1 [27] แสดงถึงแบบจำลองของฟิล์มบางที่ปลูกบน Substrate ซึ่งตัวแปรต่างๆ แสดงไว้ดังนี้ ค่าคงที่ทางแสงของอากาศ ฟิล์มและ Substrate ตามลำดับซึ่งแสดงอยู่ในรูปของจำนวนเชิงซ้อน (N_0, N_1, N_2) โดยที่ N สามารถเขียนให้อยู่ในลักษณะ $n+ik$ ซึ่ง n คือดรรชนีหักเหและ k คือค่าสัมประสิทธิ์ของการดูดซึม (Extinction coefficient) ความหนาของฟิล์ม (d) และมุมของแสงที่ทำกับเส้นตั้งฉากกับพื้นผิวของฟิล์ม (θ)



รูปที่ ก.1 การแทรกสอดของแสงในฟิล์มบาง [27]

จากเส้นทางเดินของแสงในรูปที่ ก.1 สามารถเขียนเฟสของแสงที่แตกต่างกันระหว่าง \overline{AD} และ \overline{AC} ได้ดังนี้

$$\alpha = \frac{2\pi N_1}{\lambda} (\overline{AB} - \overline{BC}) - \frac{2\pi N_0}{\lambda} (\overline{AD}) \quad \text{--- (ก.1)}$$

ซึ่งจากรูปที่ ก.1 จะเห็นว่า $\overline{AD} = \overline{AC} \sin(\theta_0)$ และ $\overline{AC} = 2d \tan(\theta_1)$ ซึ่งจากกฎของ Snell

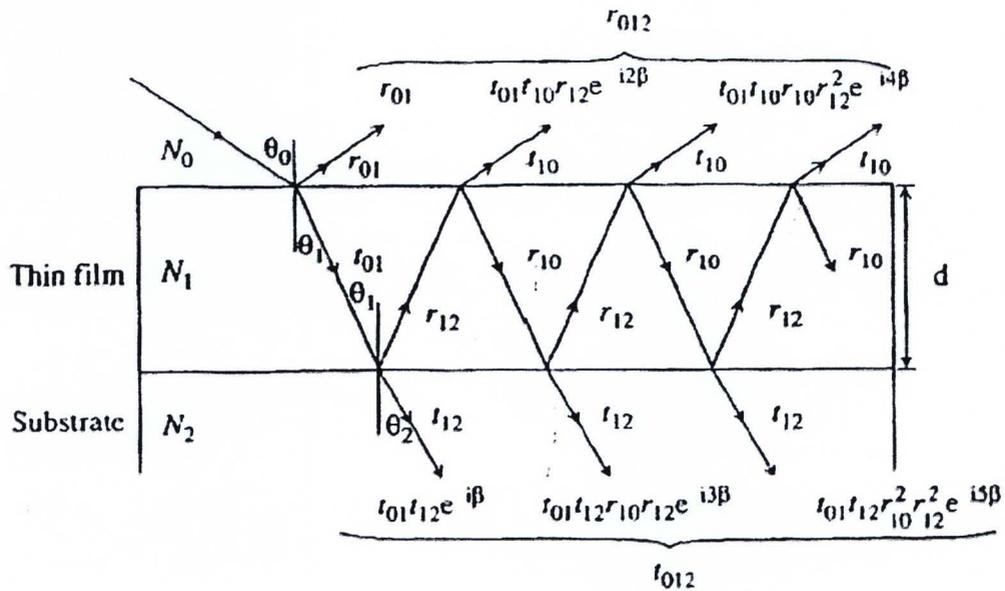
$$\overline{AD} = 2d \frac{\sin^2(\theta_1) \cdot N_1}{\cos(\theta_1) N_0} \quad \text{--- (ก.2)}$$

จากการแทนสมการ (ก.2) ด้วย $\overline{AB} = \overline{BC} = \frac{d}{\cos(\theta_1)}$ ในสมการ (ก.1) จะได้

$$\alpha = \frac{4\pi d N_1}{\lambda} \left(\frac{1 - \sin^2(\theta_1)}{\cos(\theta_1)} \right) = \frac{4\pi d N_1}{\lambda} \cos(\theta_1) = 2\beta \quad \text{--- (ก.3)}$$

ซึ่งสามารถคำนวณเฟสที่แตกต่างกันเนื่องจากความหนาของฟิล์ม (Film phase thickness) ได้จาก

$$\beta = \frac{2\pi d}{\lambda} N_1 \cos(\theta_1) = \frac{2\pi d}{\lambda} (N_1^2 - N_1^2 \sin^2(\theta_0))^{1/2} \quad \text{--- (ก.4)}$$



รูปที่ ก.2 แบบจำลองการแทรกสอดของแสงระหว่างชั้นตัวกลาง อากาศ ฟิล์มบางและ Substrate [27]

จากรูปที่ ก.2 [27] แสดงถึงแบบจำลองการแทรกสอดของแสงระหว่างชั้นตัวกลาง อากาศ ฟิล์มบางและ Substrate ซึ่ง r_{ij} และ t_{ij} แสดงถึงแอมพลิจูดของสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง (Reflection) และการเดินทางของแสง (Transmission) ของแต่ละชั้นของตัวกลาง ซึ่งจากสมการของ Fresnel ของ p- และ s-polarization จะได้ว่า

$$r_{ij,p} = \frac{N_j \cos(\theta_i) - N_i \cos(\theta_j)}{N_j \cos(\theta_i) + N_i \cos(\theta_j)}, \quad r_{ij,s} = \frac{N_i \cos(\theta_i) - N_j \cos(\theta_j)}{N_i \cos(\theta_i) + N_j \cos(\theta_j)} \quad \text{--- (ก.5)}$$

$$t_{ij,p} = \frac{2N_i \cos(\theta_i)}{N_j \cos(\theta_i) + N_i \cos(\theta_j)}, \quad t_{ij,s} = \frac{2N_i \cos(\theta_i)}{N_i \cos(\theta_i) + N_j \cos(\theta_j)} \quad \text{--- (ก.6)}$$

ซึ่งสามารถคำนวณแอมพลิจูดของสัมประสิทธิ์การสะท้อนของแสงทั้งหมด (r_{012}) ที่สะท้อนออกมาจากแบบจำลองได้จากผลรวมของแสงที่สะท้อนออกมาทุกเส้นได้ดังนี้

$$r_{012} = r_{01} + t_{01}t_{10}r_{12}e^{i2\beta} + t_{01}t_{10}r_{10}r_{12}^2e^{i4\beta} + t_{01}t_{10}r_{10}^2r_{12}^3e^{i6\beta} + \dots \quad \text{--- (ก.7)}$$

จากอนุกรมอนันต์ $y = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$ จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูป $y = \frac{a}{1-r}$

ได้ตั้งนั้นจากสมการที่ (ก.7) จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ดังนี้

$$r_{012} = r_{01} + \left[\frac{t_{01}t_{10}r_{12}e^{(2i\beta)}}{1 - r_{10}r_{12}e^{(2i\beta)}} \right] \quad \text{--- (ก.7)}$$

จากความสัมพันธ์ $r_{10} = -r_{01}$ และ $t_{01}t_{10} = 1 - r_{01}^2$ ทำให้สามารถเขียนสมการที่ (ก.7) ให้อยู่ในอยู่ในรูปดังนี้

$$r_{012} = \left[\frac{r_{01} + r_{12}e^{(2i\beta)}}{1 + r_{10}r_{12}e^{(2i\beta)}} \right] \quad \text{--- (ก.8)}$$

ในทำนองเดียวกันก็จะสามารถเขียนสมการของการเดินทางผ่านของแสงจากแบบจำลองได้ตั้งสมการที่ (ก.9)

$$t_{012} = \left[\frac{t_{01}t_{12}e^{(i\beta)}}{1 + r_{10}r_{12}e^{(2i\beta)}} \right] \quad \text{--- (ก.9)}$$

ซึ่งจากสมการที่ (ก.8) และ (ก.9) แอมพลิจูดของสัมประสิทธิ์การสะท้อนของแสงและการเดินทางผ่านของแสงของแบบจำลองสามารถคำนวณได้จาก

$$r_{012,p} = \left[\frac{r_{01,p} + r_{12,p}e^{(2i\beta)}}{1 + r_{10,p}r_{12,p}e^{(2i\beta)}} \right], \quad r_{012,s} = \left[\frac{r_{01,s} + r_{12,s}e^{(2i\beta)}}{1 + r_{10,s}r_{12,s}e^{(2i\beta)}} \right] \quad \text{--- (ก.10)}$$

$$t_{012,p} = \left[\frac{t_{01,p} t_{12,p} e^{(i\beta)}}{1 + r_{10,p} r_{12,p} e^{(2i\beta)}} \right], \quad t_{012,s} = \left[\frac{t_{01,s} t_{12,s} e^{(i\beta)}}{1 + r_{10,s} r_{12,s} e^{(2i\beta)}} \right] \quad \text{--- (ก.11)}$$

จากสมการที่ (ก.10) และ (ก.11) ทำให้สามารถคำนวณอัตราส่วนความเข้มแสง (ความเข้มแสงที่สะท้อนออกจากแบบจำลองต่อความเข้มแสงที่ตกกระทบกับแบบจำลอง) ได้ดังสมการที่ (ก.12)

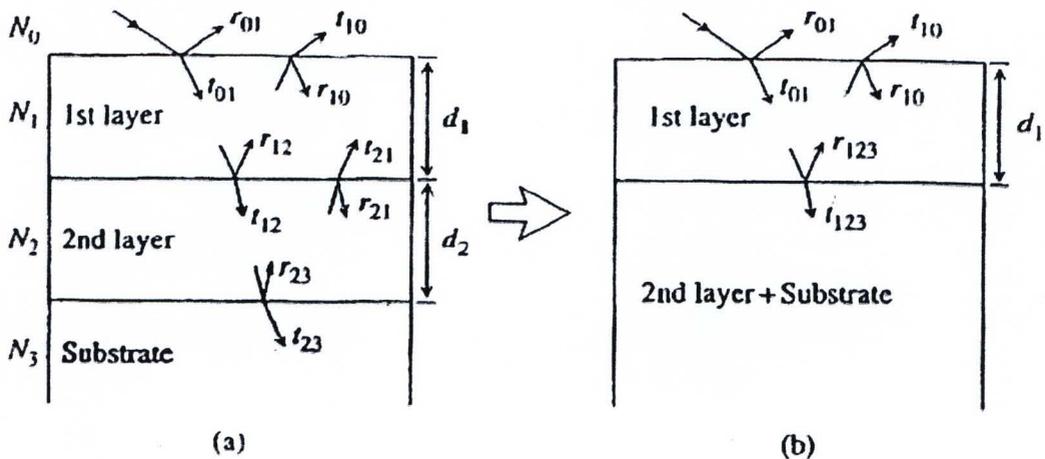
$$\frac{I_{s,p}}{I_{0,p}} = \left| \frac{E_{s,p}}{E_{0,p}} \right|^2 = |r_{012,p}|^2, \quad \frac{I_{s,s}}{I_{0,s}} = \left| \frac{E_{s,s}}{E_{0,s}} \right|^2 = |r_{012,s}|^2 \quad \text{--- (ก.12)}$$

โดยที่มุมตกกระทบและมุมที่แสงเดินทางผ่านชั้นตัวกลางสามารถคำนวณได้จากกฎของ Snell ดังนี้

$$N_0 \sin(\theta_0) = N_1 \sin(\theta_1) = N_2 \sin(\theta_2) \quad \text{--- (ก.13)}$$

ก.2 ฟิล์มหลายชั้นบน Substrate (Multilayers)

การคำนวณการแทรกสอดของแสงในฟิล์มที่มีหลายชั้นสามารถใช้วิธีเดียวกันกับที่ได้อธิบายไปในหัวข้อที่ 1 แล้วจากรูปที่ ก.3 [27] แสดงถึงแบบจำลองของการแทรกสอดของแสงในฟิล์ม 2 ชั้นบน Substrate ซึ่งจะสามารถแบ่งการคำนวณได้ดังที่แสดงไว้อย่างรูปที่ ก.3 (b) โดยจะทำการคำนวณฟิล์มชั้นที่ 2 (2nd layer) กับ Substrate ก่อนโดยใช้สมการที่ (ก.8) และ (ก.9) โดยที่มีตัวแปรต่างๆดังที่แสดงไว้ในรูปที่ ก.3



รูปที่ ก.3 วิธีการคำนวณการแทรกสอดของแสงในฟิล์มที่มีหลายชั้น [27]

การคำนวณแอมพลิจูดของสัมประสิทธิ์การสะท้อนของแสงและการเดินทางผ่านของแสงของฟิล์มชั้นที่ 2 กับ Substrate แสดงไว้ยังสมการที่ (ก.14) และ (ก.15)

$$r_{123} = \left[\frac{r_{12} + r_{23}e^{(2i\beta_2)}}{1 + r_{12}r_{23}e^{(2i\beta_2)}} \right] \quad \text{--- (ก.14)}$$

$$t_{123} = \left[\frac{t_{12}t_{23}e^{(i\beta_2)}}{1 + r_{12}r_{23}e^{(2i\beta_2)}} \right] \quad \text{--- (ก.15)}$$

โดยที่การเปลี่ยนแปลงของเฟสของแสงเมื่อเดินทางผ่านชั้นตัวกลางที่ 2 สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\beta_2 = \frac{2\pi d_2 N_2 \cos(\theta_2)}{\lambda} \quad \text{--- (ก.16)}$$

จากสมการที่ (ก.14) ถึง (ก.16) สามารถคำนวณแอมพลิจูดของสัมประสิทธิ์การสะท้อนของแสงและการเดินทางผ่านของแสงของแบบจำลองได้ดังนี้

$$r_{0123} = \left[\frac{r_{01} + r_{123}e^{(2i\beta_1)}}{1 + r_{01}r_{123}e^{(2i\beta_1)}} \right] \quad \text{--- (ก.17)}$$

$$t_{0123} = \left[\frac{t_{01}t_{123}e^{(i\beta_1)}}{1 + r_{01}r_{123}e^{(2i\beta_1)}} \right] \quad \text{--- (ก.18)}$$

โดยที่การเปลี่ยนแปลงของเฟสของแสงเมื่อเดินทางผ่านชั้นตัวกลางที่ 1 สามารถคำนวณได้ดังนี้

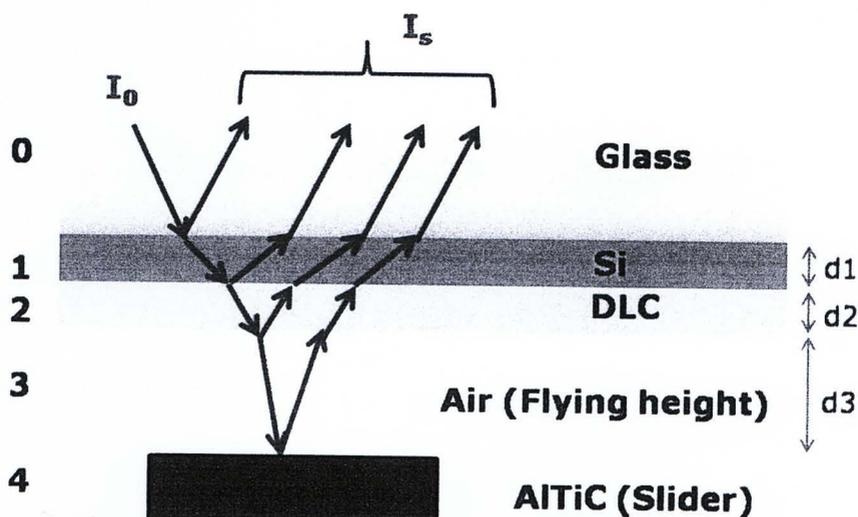
$$\beta_1 = \frac{2\pi d_1 N_1 \cos(\theta_1)}{\lambda} \quad \text{--- (ก.16)}$$

อัตราส่วนความเข้มแสง (ความเข้มแสงที่สะท้อนออกจากแบบจำลองต่อความเข้มแสงที่ตกกระทบกับแบบจำลองสามารถคำนวณได้ดังสมการต่อไปนี้

$$\frac{I_{s,p}}{I_{0,p}} = \left| \frac{E_{s,p}}{E_{0,p}} \right|^2 = |r_{0123,p}|^2, \quad \frac{I_{s,s}}{I_{0,s}} = \left| \frac{E_{s,s}}{E_{0,s}} \right|^2 = |r_{0123,s}|^2 \quad \text{--- (ก.17)}$$

ก.3 การแทรกสอดของแสงในการวัด Flying height โดยใช้ดิסקที่มีชั้นของซิลิกอนและ DLC

จากวิธีการคำนวณที่ได้อธิบายไว้ยังหัวข้อที่ 1 และ 2 สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนความเข้มแสงที่สะท้อนออกมาจากแบบจำลองการวัด Flying height ด้วยจานแก้วที่เคลือบด้วยซิลิกอนและ DLC ได้ โดยแบบจำลองการสะท้อนของแสงในการวัด Flying height แสดงไว้ดังรูปที่ ก.4 โดยที่แสงที่ตกกระทบทำมุมตั้งฉากกับผิวจานแก้ว ($\theta_0 = 0$)



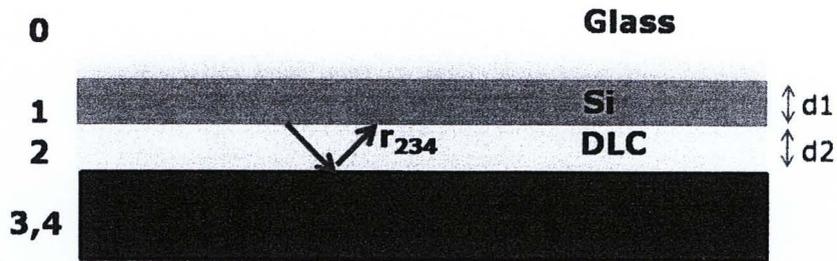
รูปที่ ก.4 แบบจำลองการสะท้อนของแสงในการวัด Flying height ด้วยจานแก้วที่เคลือบด้วยซิลิกอนและ DLC

จากรูปที่ ก.4 จะเริ่มจากการยุบรวมของชั้นของตัวกลางที่ 3 (อากาศ) และ 4 (AlTiC slider) ซึ่งสามารถการคำนวณแอมพลิจูดของสัมประสิทธิ์การสะท้อนของแสงของฟิล์มชั้นที่ 3 กับ 4 และการเปลี่ยนแปลงของเฟสของแสงเมื่อเดินทางผ่านชั้นตัวกลางที่ 3 ได้ดังนี้

$$r_{234} = \left[\frac{r_{23} + r_{34}e^{(2i\beta_3)}}{1 + r_{23}r_{34}e^{(2i\beta_3)}} \right] \quad \text{--- (ก.18)}$$

$$\beta_3 = \frac{2\pi d_3 N_3}{\lambda} \quad \text{--- (ก.19)}$$

โดยรูปที่ ก.5 แสดงถึงรูปที่ ก.4 หลังจากการยุบรวมของชั้นตัวกลางที่ 3 และ 4



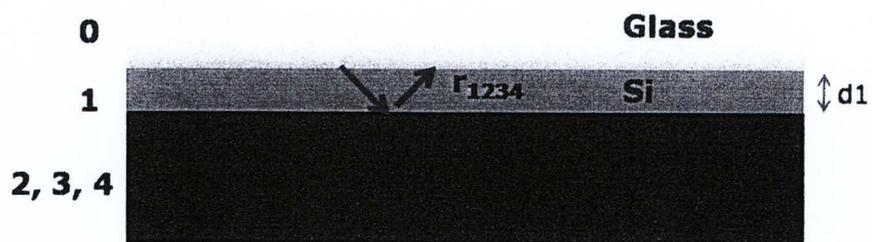
รูปที่ ก.5 แบบจำลองการวัด Flying height หลังจากยุบรวมชั้นตัวกลางที่ 3 และ 4

หลังจากนั้นทำการยุบรวมชั้นของตัวกลางที่ 2 (DLC) และ 3, 4 ซึ่งสามารถคำนวณแอมพลิจูดของสัมประสิทธิ์การสะท้อนของแสงของฟิล์มชั้นที่ 2 กับ 3, 4 และการเปลี่ยนแปลงของเฟสของแสงเมื่อเดินทางผ่านชั้นตัวกลางที่ 2 ได้ดังนี้

$$r_{1234} = \left[\frac{r_{12} + r_{234}e^{(2i\beta_2)}}{1 + r_{12}r_{234}e^{(2i\beta_2)}} \right] \quad \text{--- (ก.20)}$$

$$\beta_2 = \frac{2\pi d_2 N_2}{\lambda} \quad \text{--- (ก.21)}$$

โดยรูปที่ ก.6 แสดงถึงรูปที่ ก.4 หลังจากการยุบรวมของชั้นตัวกลางที่ 2 และ 3, 4



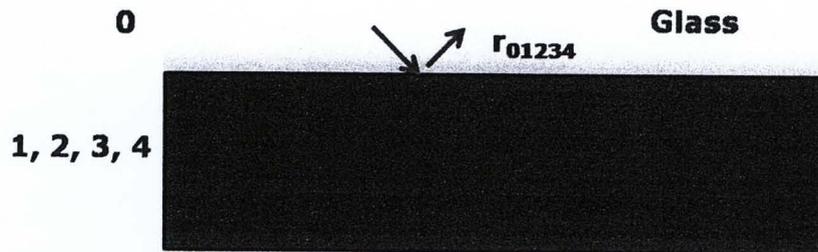
รูปที่ ก.6 แบบจำลองการวัด Flying height หลังจากยุบรวมชั้นตัวกลางที่ 2 และ 3, 4

หลังจากนั้นทำการยุบรวมชั้นของตัวกลางที่ 1 (ซิลิกอน) และ 2, 3, 4 ซึ่งสามารถคำนวณแอมพลิจูดของสัมประสิทธิ์การสะท้อนของแสงของฟิล์มชั้นที่ 1 กับ 2, 3, 4 และการเปลี่ยนแปลงของเฟสของแสงเมื่อเดินทางผ่านชั้นตัวกลางที่ 1 ได้ดังนี้

$$r_{01234} = \left[\frac{r_{01} + r_{1234}e^{(2i\beta_1)}}{1 + r_{01}r_{1234}e^{(2i\beta_1)}} \right] \quad \text{--- (ก.22)}$$

$$\beta_1 = \frac{2\pi d_1 N_1}{\lambda} \quad \text{--- (ก.23)}$$

โดยรูปที่ ก.7 แสดงถึงรูปที่ ก.4 หลังจากการยุบรวมของชั้นตัวกลางที่ 1 และ 2, 3, 4 โดยที่ r_{01234} คือแอมพลิจูดของสัมประสิทธิ์การสะท้อนของแสงทั้งหมดที่สะท้อนออกมาจากแบบจำลองการวัด Flying height



รูปที่ ก.7 แบบจำลองการวัด Flying height หลังจากยุบรวมชั้นตัวกลางที่ 1 และ 2, 3, 4

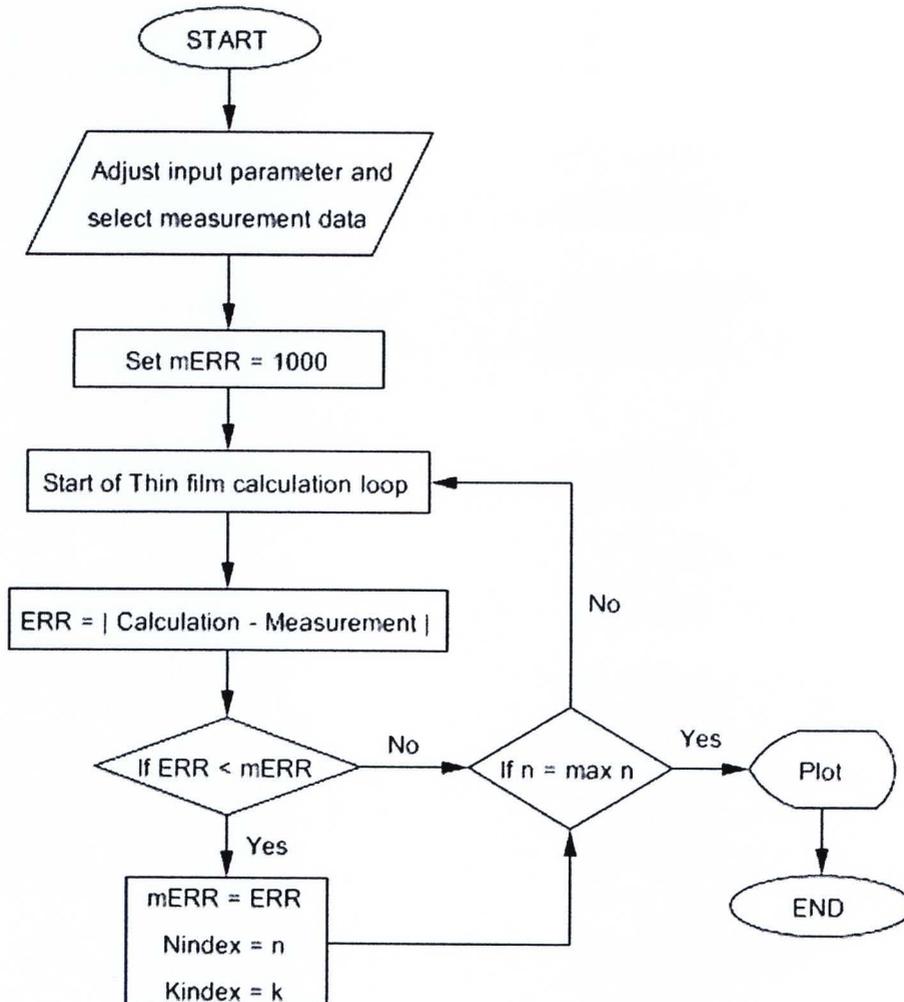
ซึ่งสามารถคำนวณอัตราส่วนความเข้มแสงทั้งหมดที่สะท้อนออกมาจากแบบจำลองได้ดังนี้

$$\frac{I_s}{I_0} = \left| \frac{E_s}{E_0} \right|^2 = |r_{01234}|^2 \quad \text{--- (ก.24)}$$

ภาคผนวก ข

ชุดคำสั่งของโปรแกรมที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้ Matlab เพื่อใช้ในการคำนวณ

ข.1 โปรแกรมเพื่อ Fitting หาค่าดรรชนีหักเหของดิสก์จากค่าความเข้มแสงที่ได้จากการวัด



รูปที่ ข.1 Flowchart ของโปรแกรมที่ ข.1


```

    PT2_max(4) = 2264;
elseif Mode == 3
    PT2(1) = 318.363;
    PT2(2) = 584.634;
    PT2(3) = 875.948;
    PT2(4) = 1143.104;

%=====
    PT2_min(1) = 336;
    PT2_min(2) = 341;
    PT2_min(3) = 317;
    PT2_min(4) = 309;

%=====
    PT2_max(1) = 1595;
    PT2_max(2) = 1567;
    PT2_max(3) = 1604;
    PT2_max(4) = 1595;
end
elseif L == 550e-9
    Ng = 1.51+0.01i;
    Ns = 3.789+0.951i;
    Nd = 2.1699+0.1416i;
    Na = 1;
    Nh = 2.354+0.363i;
    if Mode == 1
        PT2(1) = 926.152;
        PT2(2) = 1268;
        PT2(3) = 1612.227;
        PT2(4) = 1910.342;

%=====
        PT2_min(1) = 736;
        PT2_min(2) = 717;
        PT2_min(3) = 724;
        PT2_min(4) = 717;

%=====
        PT2_max(1) = 2250;
        PT2_max(2) = 2174;
        PT2_max(3) = 2261;
        PT2_max(4) = 2257;
    elseif Mode == 2
        PT2(1) = 603.834;
        PT2(2) = 834.358;
        PT2(3) = 1171.059;
        PT2(4) = 1533.226;

%=====
        PT2_min(1) = 635;
        PT2_min(2) = 616;
        PT2_min(3) = 615;
        PT2_min(4) = 604;

%=====
        PT2_max(1) = 2255;
        PT2_max(2) = 2186;
        PT2_max(3) = 2259;
        PT2_max(4) = 2255;
    elseif Mode == 3
        PT2(1) = 237.783;
        PT2(2) = 446.363;
        PT2(3) = 726.075;
        PT2(4) = 1007.907;

%=====
        PT2_min(1) = 279;
        PT2_min(2) = 278;

```

```

% Glass
% Si amorphous
% DLC
% Air
% AlTiC

```

```

        PT2_min(3) = 256;
        PT2_min(4) = 250;
%=====
        PT2_max(1) = 1578;
        PT2_max(2) = 1569;
        PT2_max(3) = 1598;
        PT2_max(4) = 1596;
    end
elseif L == 650e-9
    Ng = 1.52; % Glass
    Ns = 3.711+0.7261i; % Si amorphous
    Nd = 2.1631+0.0985i; % DLC
    Na = 1; % Air
    Nh = 2.289+0.344i; % AlTiC
    if Mode == 1
        PT2(1) = 907.842;
        PT2(2) = 1250.883;
        PT2(3) = 1625.133;
        PT2(4) = 1984.017;
%=====
        PT2_min(1) = 727;
        PT2_min(2) = 689;
        PT2_min(3) = 710;
        PT2_min(4) = 699;
%=====
        PT2_max(1) = 2639;
        PT2_max(2) = 2542;
        PT2_max(3) = 2643;
        PT2_max(4) = 2640;
    elseif Mode == 2
        PT2(1) = 598.335;
        PT2(2) = 830.244;
        PT2(3) = 1181.986;
        PT2(4) = 1594.638;
%=====
        PT2_min(1) = 628;
        PT2_min(2) = 599;
        PT2_min(3) = 610;
        PT2_min(4) = 592;
%=====
        PT2_max(1) = 2725;
        PT2_max(2) = 2637;
        PT2_max(3) = 2728;
        PT2_max(4) = 2735;
    elseif Mode == 3
        PT2(1) = 214.815;
        PT2(2) = 391.986;
        PT2(3) = 687.532;
        PT2(4) = 1026.384;
%=====
        PT2_min(1) = 250;
        PT2_min(2) = 246;
        PT2_min(3) = 246;
        PT2_min(4) = 234;
%=====
        PT2_max(1) = 1971;
        PT2_max(2) = 1952;
        PT2_max(3) = 1981;
        PT2_max(4) = 1980;
    end
end
end

```

```

%---- DEFINE FILM THICKNESS AND FH FROM MEASUREMENT
if Mode == 1
    fhm2(1) = 19.79;           % FH from measurement of each point
    fhm2(2) = 43.6;
    fhm2(3) = 61.99;
    fhm2(4) = 81.98;
    TXT = 'Glass';
elseif Mode == 2
    T = 1e-9;                 % Si thickness
    fhm2(1) = 19.79;
    fhm2(2) = 43.6;
    fhm2(3) = 61.99;
    fhm2(4) = 81.98;
    TXT = 'Si 1nm';
elseif Mode == 3
    T = 5e-9;                 % Si thickness
    fhm2(1) = 19.79;
    fhm2(2) = 43.6;
    fhm2(3) = 61.99;
    fhm2(4) = 81.98;
    TXT = 'Si 5nm';
end
for Nc = NS:ST:NF
    for Kc = KS:ST:KF
        Iter = Iter+1;
        nc = [complex(Nc,Kc), % refractive index of composite
              1, % which iterated(Nc,Kc)
              1, % refractive index of air
              Nh]; % refractive index of AlTiC
%=====
%===== ASSIGN Rij, Tij =====
%=====
        for u = 1:length(nc)
            for v = 1:length(nc)
                rco(u,v) = (nc(u)-nc(v))/(nc(u)+nc(v));
                tco(u,v) = 2*nc(u)/(nc(u)+nc(v));
            end
        end
%=====
%===== DEFINE 1st composite layer =====
%=====
%----COMP-----1
%----Air-----2
%----AlTiC-----3
        Rdm = rco(1,2); % Beam which reflect from middle layer
        Rdb = rco(2,3); % Beam which reflect from bottom layer
        for u = 1:length(fh)
            Bc(u) = (2*pi*fh(u)*nc(2))/L;
            RC(u,1) = (Rdm+Rdb*(exp(2*i*Bc(u))))/(1+Rdm*Rdb*(exp(2*i*Bc(u))));
            AmpC(u,1) = abs(RC(u,1))^2;
            PhsC(u,1) = angle(RC(u,1));
        end
%=====
%===== NORMALIZED INTENSITY TO 0-2 =====
%=====
        AmpC_N = AmpC-min(AmpC);
        m_CN = 2/max(AmpC_N);
        AmpC_N2 = AmpC_N.*m_CN;
%=====
%===== MEASUREMENT LOOP =====

```

```

=====
% Use intensity from measurement from each case to re-plot FH
if MEA == 1
    PT = PT1;
    PT_min = PT1_min;
    PT_max = PT1_max;
    fhm = fhm1+SHF;
    MTXT = '1st';
elseif MEA == 2
    PT = PT2;
    PT_min = PT2_min;
    PT_max = PT2_max;
    fhm = fhm2+SHF;
    MTXT = '2nd';
elseif MEA == 3
    PT = PT3;
    PT_min = PT3_min;
    PT_max = PT3_max;
    fhm = fhm3+SHF;
    MTXT = '3rd';
elseif MEA == 0
    ac1 = 0;
    %==== Merge data from 1&2 measurement ====
    for a1 = 1:length(fhm1)
        fhmd(a1,1) = fhm1(a1);
        PTd(a1,1) = PT1(a1);
        PTd_min(a1,1) = PT1_min(a1);
        PTd_max(a1,1) = PT1_max(a1);
    end
    for a2 = length(fhm1)+1:length(fhm1)+length(fhm2)
        ac1 = ac1+1;
        fhmd(a2,1) = fhm2(ac1);
        PTd(a2,1) = PT2(ac1);
        PTd_min(a2,1) = PT2_min(ac1);
        PTd_max(a2,1) = PT2_max(ac1);
    end
    %==== Sort intensity data by ascending fh ====
    fhmdS = sort(fhmd);
    for as = 1:length(fhmd)
        for as2 = 1:length(fhmd)
            if fhmdS(as) == fhmd(as2)
                A_index(as,1) = as2;
            end
        end
    end
    %==== Define all necessary input parameters ====
    for Is = 1:length(fhmd)
        PT(Is,1) = PTd(A_index(Is));
        PT_min(Is,1) = PTd_min(A_index(Is));
        PT_max(Is,1) = PTd_max(A_index(Is));
    end
    fhm = fhmdS+SHF;
    MTXT = 'ALL';
end
for m = 1:length(fhm)
    IP(m) = ((PT(m)-PT_min(m))/(PT_max(m)-PT_min(m)))*2;
    if IP(m) < 0
        IP(m) = 0;
    end
end
end

```

```

if FT_ON == 0
    break, end
%=====
%===== FITTING LOOP =====
%=====
% Fit N&K which its intensity give nearest FH to measurement data
CT = 0;
Cf = 0;
for u = FT_S:FT_ST
    CT = CT+1;
    mI = 200;
    for v = 1:round(max(fhm))+1+5
        Cf = Cf+1;
        fERR(Cf,1) = abs(AmpC_N2(v)-IP(u));
        if fERR(Cf,1)<mI
            mI = fERR(Cf,1);
            fhC = v-1;
        end
    end
    FHC(CT) = fhC; % Find the FH of each intensity which
nearest to measured intensity
end
Sfhm = size(fhm(FT_S:FT_ST));
SFHC = size(FHC);
if Sfhm(1,1) ~= SFHC(1,1)
    FHC = FHC';
end
ERR(Iter,1) = sum((fhm(FT_S:FT_ST)-FHC).^2);
if ERR(Iter)< mERR
    mERR = ERR(Iter);
    Nindex = Nc;
    Kindex = Kc;
    FHC2 = FHC;
end
end
end
if FT_ON == 1
%=====
%===== FOR PLOT =====
%=====
np = [complex(Nindex,Kindex), % refractive index of composite
      1, % which iterated(Nc,Kc)
      Nh]; % refractive index of air
%=====
%===== ASSIGN Rij,Tij =====
%=====
for u = 1:length(np)
    for v = 1:length(np)
        rcp(u,v) = (np(u)-np(v))/(np(u)+np(v));
        tcp(u,v) = 2*np(u)/(np(u)+np(v));
    end
end
%=====
%===== DEFINE 1st composite layer =====
%=====
%---COMP-----1
%---Air-----2
%---AlTiC-----3
Rdm = rcp(1,2); % Beam which reflect from middle layer
Rdb = rcp(2,3); % Beam which reflect from bottom layer

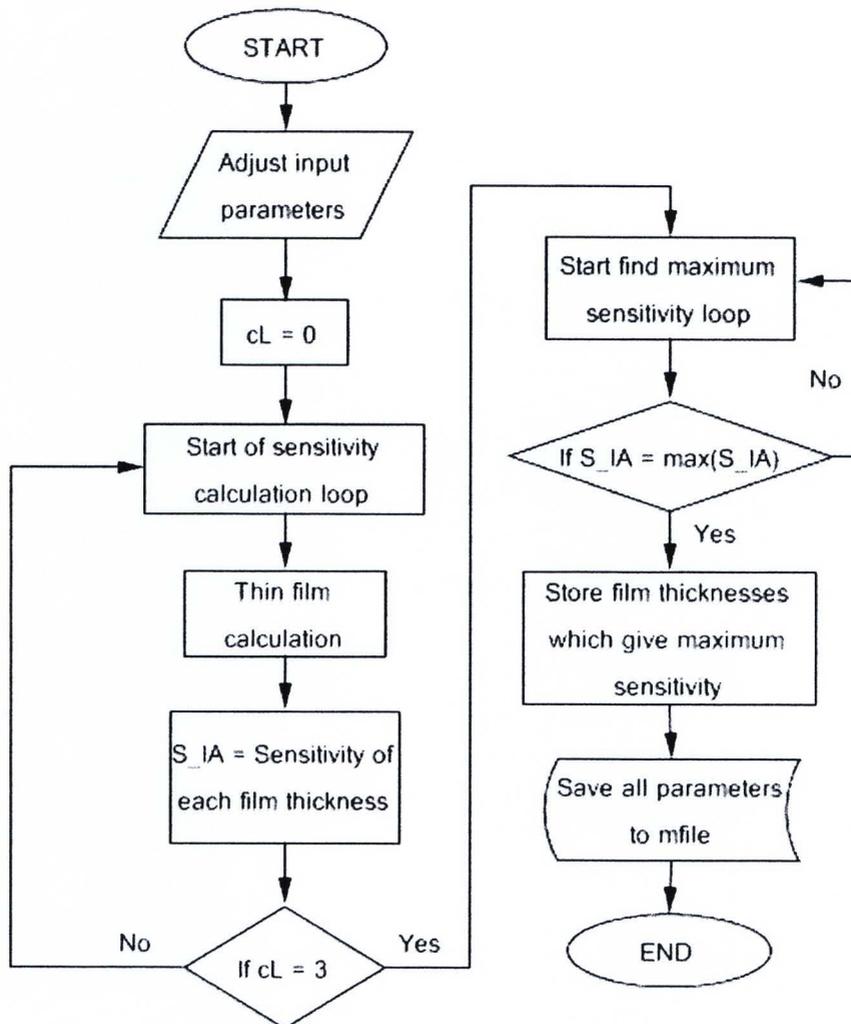
```

```

        for u = 1:length(fh)
            Bp(u) = (2*pi*fh(u)*np(2))/L;
            Rp(u,1) = (Rdm+Rdb*(exp(2*i*Bp(u))))/(1+Rdm*Rdb*(exp(2*i*Bp(u))));
            AmpP(u,1) = abs(Rp(u,1))^2;
            PhsP(u,1) = angle(Rp(u,1));
        end
=====
=====          NORMALIZED INTENSITY TO 0-2          =====
=====
            AmpP_N = AmpP-min(AmpP);
            m_PN = 2/max(AmpP_N);
            AmpP_N2 = AmpP_N.*m_PN;
=====
            if L == 450e-9
                Co = 'b';
                Co2 = 'b*';
            elseif L == 550e-9
                Co = 'g';
                Co2 = 'g*';
            elseif L == 650e-9
                Co = 'r';
                Co2 = 'r*';
            end
            plot(fh(1:PLD).*10^9,AmpP_N2(1:PLD),Co,fhm,IP,Co2)
            legend(['n = ',num2str(Nindex),'k = ',num2str(Kindex)])
            title(['Fitting of ',TXT,' disk with ',MTXT,' measurement data with
            point ',num2str(FT_S),' to ',num2str(FT_ST),])
            ylabel('Intensity ratio')
            xlabel('FH(nm)')
            grid on
            grid minor
            end
=====
===== END PROGRAM =====

```

ข.2 โปรแกรมเพื่อ Optimize sensitivity โดยการเปลี่ยนแปลงความหนาของซิลิกอนและ DLC



รูปที่ ข.2 Flowchart ของโปรแกรมที่ ข.2

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BEGIN PROGRAM %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
clc
clear all
%=====
%===== INPUT PARAMETERS =====
%=====
fh = [0e-9:1e-9:400e-9];           % Flying height (Air gap)
T1 = [0e-9:0.5e-9:2e-9];         % 1st SiO2 thickness
d1 = [45e-9:1e-9:65e-9];         % 1st DLC thickness
T2 = [2e-9:0.5e-9:4e-9];         % SiO2 thickness
d2 = [15e-9:1e-9:35e-9];         % 2nd DLC thickness
WL = [450e-9,550e-9,650e-9];     % Wave length 650/550/450e-9
                                   % only are allowed

Add_layer = 'Si';

%=====
%===== LAYER =====
%=====
cL = 0;
MX = 0;
for iL = 1:length(WL)
    L = WL(iL);
    cL = cL+1;    % Define loop number
    cs = 0;
    if L == 450e-9
        Ng = 1.54+0.02i;           % Glass
        Ns = 4.419+1.328i;         % Si amorphous
        Nso = 1.465;               % SiO2
        Nal = 1.78;                % Al2O3
        Nd = 2.169+0.2087i;        % DLC
        Na = 1;                    % Air
        Nh = 2.39+0.432i;         % AlTiC
    elseif L == 550e-9
        Ng = 1.51+0.01i;           % Glass
        Ns = 4.232+0.634i;         % Si amorphous
        Nso = 1.459;               % SiO2
        Nal = 1.77;                % Al2O3
        Nd = 2.1699+0.1416i;       % DLC
        Na = 1;                    % Air
        Nh = 2.354+0.363i;        % AlTiC
    elseif L == 650e-9
        Ng = 1.52;                 % Glass
        Ns = 4.014+0.309i;         % Si amorphous
        Nso = 1.456;               % SiO2
        Nal = 1.765;               % Al2O3
        Nd = 2.1631+0.0985i;       % DLC
        Na = 1;                    % Air
        Nh = 2.289+0.344i;        % AlTiC
    end
    %----GLASS-----1
    %----SiO2-----2
    %----DLC1-----3
    %----SiO2-----4
    %----DLC2-----5
    %----Air-----6
    %----AlTiC-----7
    if Add_layer == 'S'
        n = [Ng,      % Glass
             Nso,     % SiO2 (T1)
             Nd,      % DLC 1
             Nso,     % SiO2 (T2)
             Nd,      % DLC 2

```

```

        Na,      % Air
        Nh];    % AlTiC
elseif Add_layer == 'A'
    n = [Ng,    % Glass
        Na1,   % Al2O3_1
        Nd,    % DLC 1
        Na1,   % Al2O3_2
        Nd,    % DLC 2
        Na,    % Air
        Nh];   % AlTiC
elseif Add_layer == 'Si'
    n = [Ng,    % Glass
        Ns,    % Si1
        Nd,    % DLC 1
        Ns,    % Si2
        Nd,    % DLC 2
        Na,    % Air
        Nh];   % AlTiC
end

=====
%=====          ASSIGN Rij,Tij          =====
%=====
for u = 1:length(n)
    for v = 1:length(n)
        r(u,v) = (n(u)-n(v))/(n(u)+n(v));
        t(u,v) = 2*n(u)/(n(u)+n(v));
    end
end
c= 0;
cd = 0;
for z = 1:length(T1)
    for x = 1:length(d1)
        for w = 1:length(T2)
            for v = 1:length(d2)
                for u = 1:length(fh)
%=====
%=====          DEFINE 1st composite layer          =====
%=====
%----DLC2-----5
%----Air-----6
%----AlTiC-----7
    Rdm = r(5,6); % Beam which reflect from middle layer
    Rdb = r(6,7); % Beam which reflect from bottom layer
    B(u) = (2*pi*fh(u)*n(6))/L; % BETA, Below r of composite 1
    rc1(u,1) = (Rdm+Rdb*(exp(2*i*B(u))))/(1+Rdm*Rdb*(exp(2*i*B(u))));
%=====
%=====          DEFINE 2nd composite layer          =====
%=====
%-----SiO2-----4
%-----DLC2-----5
%----COMP1-----rc1
A(v,1) = (2*pi*d2(v)*n(5))/L; % ALPHA, Below r of material
    Rdm = r(4,5); % Beam which reflect from middle layer
    Rdb = rc1(u,1); % Beam which reflect from bottom layer
    rc2(v,u) = (Rdm+Rdb*(exp(2*i*A(v,1))))/(1+Rdm*Rdb*(exp(2*i*A(v,1))));
%=====
%=====          DEFINE 3rd composite layer          =====
%=====
%-----DLC1-----3
%-----SiO2-----4
%----COMP2-----rc2

```

```

G(w,1) = (2*pi*T2(w)*n(4))/L; % ALPHA, Below r of material
Rdm = r(3,4); % Beam which reflect from middle layer
Rdb = rc2(v,u); % Beam which reflect from bottom layer
rc3(w,v,u)=(Rdm+Rdb*(exp(2*i*G(w,1)))/(1+Rdm*Rdb*(exp(2*i*G(w,1))));
%=====
%===== DEFINE 4th composite layer =====
%=====
%-----Glass-----2
%-----DLC1-----3
%-----COMP3-----rc3
O(x,1) = (2*pi*d1(x)*n(3))/L; % ALPHA, Below r of material
Rdm = r(2,3); % Beam which reflect from middle layer
Rdb = rc3(w,v,u); % Beam which reflect from bottom layer
rc4(x,w,v,u)=
(Rdm+Rdb*(exp(2*i*O(x,1)))/(1+Rdm*Rdb*(exp(2*i*O(x,1))));
%=====
%===== DEFINE 5th composite layer =====
%=====
%-----Glass-----1
%-----SiO2-----2
%-----COMP4-----rc4
AL = (2*pi*T1(z)*n(2))/L; % ALPHA, Below r of material
Rdm = r(1,2); % Beam which reflect from middle layer
Rdb = rc4(x,w,v,u); % Beam which reflect from bottom layer
rc5(z,x,w,v,u) = (Rdm+Rdb*(exp(2*i*AL)))/(1+Rdm*Rdb*(exp(2*i*AL)));
Amp(z,x,w,v,u) = abs(rc5(z,x,w,v,u))^2;
Phs(z,x,w,v,u) = angle(rc5(z,x,w,v,u));
if u == length(fh)
AmpN(z,x,w,v,:) = Amp(z,x,w,v,:)-min(Amp(z,x,w,v,:));
mN = 2/max(AmpN(z,x,w,v,:));
AmpN2(z,x,w,v,:) = AmpN(z,x,w,v,:).*mN;
%=====
%===== SENSITIVITY =====
%=====
cs = cs+1;
S_arr1 = [1,10,20,30,40,50];
S_arr2 = [2,12,22,32,42,52];
DS_I = AmpN2(z,x,w,v,S_arr2)-AmpN2(z,x,w,v,S_arr1);
% Dummy to store first rc3, cal from 1st value of FH
S_I(cs,cL) = sum(DS_I);
if cL == 1
Mt_index(cs,1) = z; % 1st SiO2 layer
Mt_index(cs,2) = x; % 1st DLC layer
Mt_index(cs,3) = w; % 2nd SiO2 layer
Mt_index(cs,4) = v; % 2nd DLC layer
end
end
end
end
end
end
end
end
%=====
%===== STORE SENSITIVITY OF EACH WAVELENGTH =====
%=====
if cL == 1
AmpB = AmpN2;
S_I1 = S_I(:,cL);
elseif cL == 2
AmpG = AmpN2;
S_I2 = S_I(:,cL);

```

```

elseif cL == 3
    AmpR = AmpN2;
    S_I3 = S_I(:,cL);
end
end
%=====
%=====          END CALCULATION LOOP          =====
%=====
%===== POST PROCESSING LOOP =====
S_IA = S_I1+S_I2+S_I3;
for xs = 1:cs
    if S_IA(xs) == max(S_IA)
        MX = MX+1;
        M_index(MX) = xs;
    end
end
end
for i = 1:length(M_index)
    SiO1(i) = Mt_index(M_index(i),1);
    DLC1(i) = Mt_index(M_index(i),2);
    SiO2(i) = Mt_index(M_index(i),3);
    DLC2(i) = Mt_index(M_index(i),4);

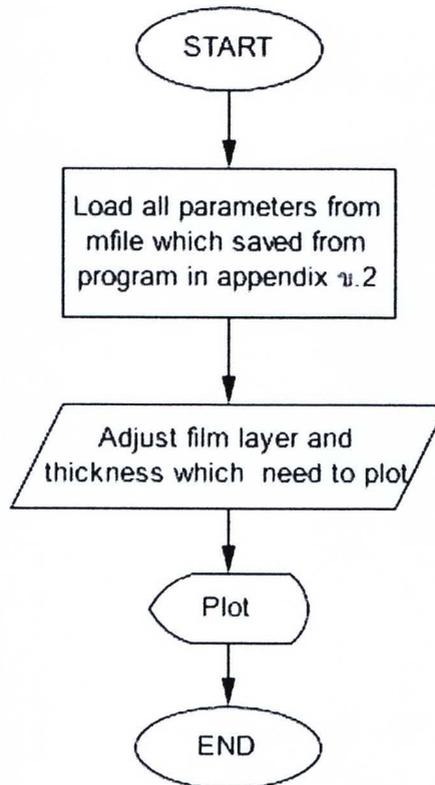
    DLC1_T(i) = d1(DLC1(i))*10^9;
    SiO1_T(i) = T1(SiO1(i))*10^9;
    DLC2_T(i) = d2(DLC2(i))*10^9;
    SiO2_T(i) = T2(SiO2(i))*10^9;
end

%=====
%=====          END PROGRAM          =====

```

ข.3 โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ Sensitivity ที่ได้จากโปรแกรม ข.2 (ต้องทำการ Run โปรแกรม ข.2 ก่อน)

สามารถ Run โปรแกรม ข.2 และบันทึกผลของโปรแกรมไว้ก่อนและนำผลมาเรียกใช้กับโปรแกรม ข.3 เพื่อวิเคราะห์ Sensitivity ในการวัด Flying height ในช่วงความหนาที่ต้องการ



รูปที่ ข.3 Flowchart ของโปรแกรมที่ ข.3

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BEGIN PROGRAM %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NEED TO RUN TEST_SENSE_2.m first
clear S_IAT i j F1 F2 X Y TF TF_L

FX = '24'; % Fix film thickness for plot, first digit
           % is 1st fixed layer where
           % the second digit define the 2nd fixed
           % layer
T_FX = 55; % Thickness of layer FX which fixed,
           % this value must not exceed range of
           % thickness of array above

T_FX2 = 25;
PLC = 2;
PLD = 400;
DLC1_T; % Real thickness DLC, SiO2 and DLC which
         % has highest sensitivity

SiO2_T;
DLC2_T;
Plus1 = 0;
Plus2 = 0;
  
```

```

for u = 1:length(fh)
    AmpBP(u,1) = AmpB(SiO1,DLC1,SiO2,DLC2,u);
    AmpGP(u,1) = AmpG(SiO1,DLC1,SiO2,DLC2,u);
    AmpRP(u,1) = AmpR(SiO1,DLC1,SiO2,DLC2,u);
end
%----Glass-----1
%----Air-----2
%----AlTiC-----3
for iL = 1:length(WL)
    L = WL(iL);
    cL = cL+1; % Define loop number
    if L == 450e-9
        Ng = 1.54+0.02i; % Glass
        Ns = 4.419+1.328i; % Si amorphous
        Nso = 1.465; % SiO2
        Nal = 1.78; % Al2O3
        Nd = 2.169+0.2087i; % DLC
        Na = 1; % Air
        Nh = 2.39+0.432i; % AlTiC
    elseif L == 550e-9
        Ng = 1.51+0.01i; % Glass
        Ns = 4.232+0.634i; % Si amorphous
        Nso = 1.459; % SiO2
        Nal = 1.77; % Al2O3
        Nd = 2.1699+0.1416i; % DLC
        Na = 1; % Air
        Nh = 2.354+0.363i; % AlTiC
    elseif L == 650e-9
        Ng = 1.52; % Glass
        Ns = 4.014+0.309i; % Si amorphous
        Nso = 1.456; % SiO2
        Nal = 1.765; % Al2O3
        Nd = 2.1631+0.0985i; % DLC
        Na = 1; % Air
        Nh = 2.289+0.344i; % AlTiC
    end
    ng = [Ng, % Glass
          Na, % Air
          Nh]; % AlTiC
    for u = 1:length(ng)
        for v = 1:length(ng)
            rg(u,v) = (ng(u)-ng(v))/(ng(u)+ng(v));
            tg(u,v) = 2*ng(u)/(ng(u)+ng(v));
        end
    end
    for u = 1:length(fh)
        Rdm = rg(1,2); % Beam which reflect from middle layer
        Rdb = rg(2,3); % Beam which reflect from bottom layer
        Bg(u) = (2*pi*fh(u)*ng(2))/L; % BETA, Below r of composite model
        Rg(u,1) = (Rdm+Rdb*(exp(2*i*Bg(u))))/(1+Rdm*Rdb*(exp(2*i*Bg(u))));
        % Light reflect from composite model
        Ampg(u,1) = abs(Rg(u,1))^2;
        Phsg(u,1) = angle(Rg(u,1));
    end
    AmpgN = Ampg-min(Ampg);
    mgN = 2/max(AmpgN);
    AmpgN2 = AmpgN.*mgN;
    if L == 450e-9
        AMPG_NB = AmpgN2;
    elseif L == 550e-9
        AMPG_NG = AmpgN2;
    end
end

```

```

elseif L == 650e-9
    AMPG_NR = AmpgN2;
end
end
if PLC == 2
    switch FX
        case '24'
            FX1 = 2;
            FX2 = 4;
            F1 = length(T1);
            F2 = length(T2);
            X = T1.*10^9;
            Y = T2.*10^9;
            TF1 = d1.*10^9;
            TF2 = d2.*10^9;
            TXT = [Add_layer,' 1st layer'];
            YTXT = [Add_layer,' 2nd layer'];
            TTXT = ['Sensitivity: fixed DLC 1st at
',num2str(T_FX),' nm and 2nd layer at ',num2str(T_FX2),' nm'];
        case '13'
            FX1 = 1;
            FX2 = 3;
            F1 = length(d1);
            F2 = length(d2);
            X = d1.*10^9;
            Y = d2.*10^9;
            TF1 = T1.*10^9;
            TF2 = T2.*10^9;
            TXT = 'DLC 1st layer';
            YTXT = 'DLC 2nd layer';
            TTXT = ['Sensitivity: fixed ',Add_layer,' 1st at
',num2str(T_FX),' nm and 2nd layer at ',num2str(T_FX2),' nm'];
        case '34'
            FX1 = 3;
            FX2 = 4;
            F1 = length(T1);
            F2 = length(d1);
            X = T1.*10^9;
            Y = d1.*10^9;
            TF1 = T2.*10^9;
            TF2 = d2.*10^9;
            TXT = [Add_layer,' 1st layer'];
            YTXT = 'DLC 1st layer';
            TTXT = ['Sensitivity: fixed ',Add_layer,' 1st at
',num2str(T_FX),' nm and 1st DLC layer at ',num2str(T_FX2),' nm'];
        end
        sT_FX = num2str(T_FX);
        fsT_FX = findstr(sT_FX,'. ');
        sT_FX2 = num2str(T_FX2);
        fsT_FX2 = findstr(sT_FX2,'. ');
        if fsT_FX > 0
            T_FX = T_FX*100;
            TF1 = TF1.*100;
            Plus1 = 1;
        end
        if fsT_FX2 > 0
            T_FX2 = T_FX2*100;
            TF2 = TF2.*100;
            Plus2 = 1;
        end
    end
    for i = 1:length(TF1)

```

```

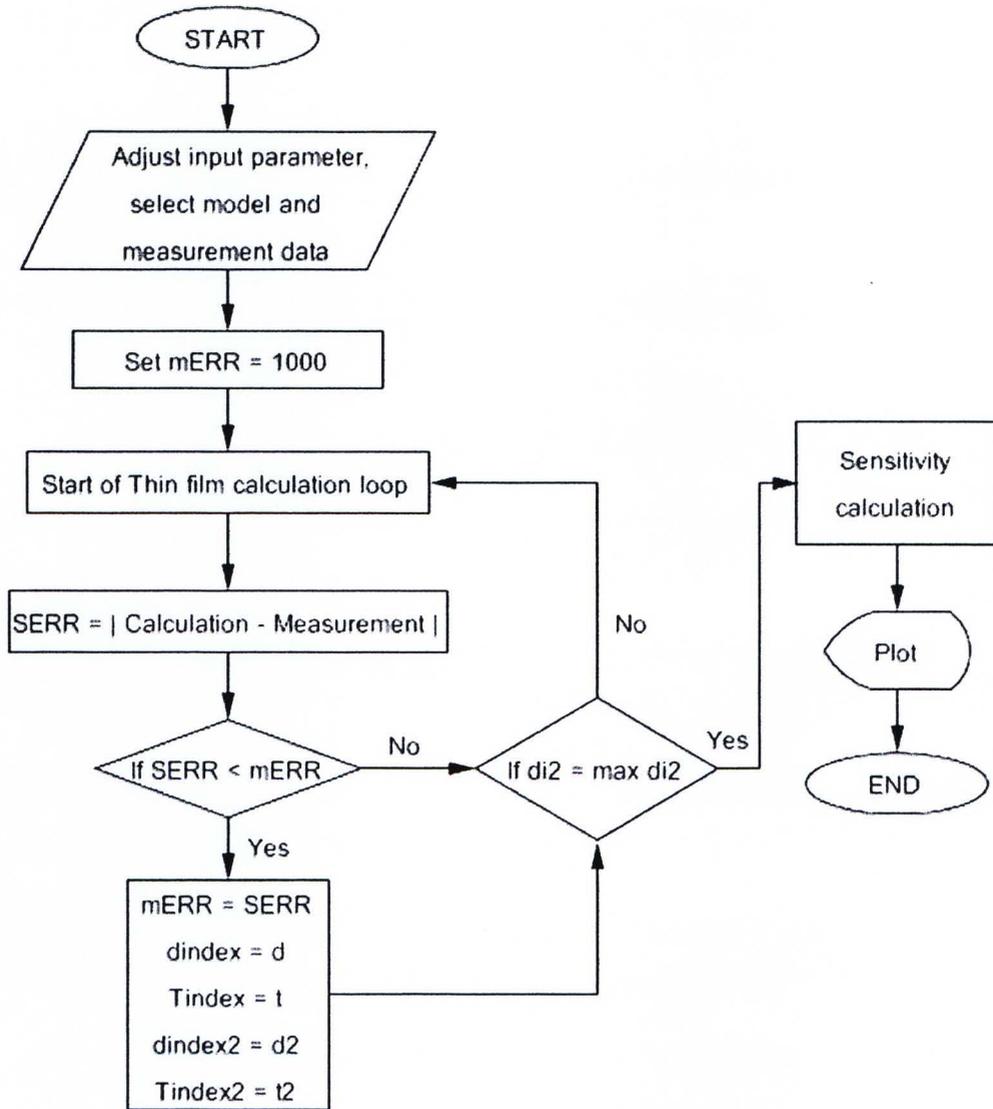
        if round(T_FX) == round(TF1(i))
            TF_L = i;
        end
    end
end
for i = 1:length(TF2)
    if round(T_FX2) == round(TF2(i))
        TF_L2 = i;
    end
end
end
if Plus1 == 1;
    T_FX = T_FX/100;
    TF1 = TF1./100;
end
if Plus2 == 1;
    T_FX2 = T_FX2/100;
    TF2 = TF2./100;
end
end
ck = 0;
for i = 1:cs
    if Mt_index(i,FX1) == TF_L && Mt_index(i,FX2) == TF_L2
        ck = ck+1;
        T_index(ck,1) = i;
    end
end
ck2 = 0;
for i = 1:F1
    for j = 1:F2
        ck2 = ck2+1;
        S_IAT(i,j) = S_IA(T_index(ck2));
    end
end
end
S_IAP = ((S_IAT-0.6013)./0.6013).*100;
S_IAT = ((S_IAT-0.6013)./0.6013).*100;

for i = 1:F1
    for j = 1:F2
        if S_IAT(i,j) < 0
            S_IAT(i,j) = 0;
        end
    end
end

for i = 1:F1
    for j = 1:F2
        if S_IAT(i,j) == max(max(S_IAT))
            XM = X(i);
            YM = Y(j);
        end
    end
end
end
contourf(X,Y,S_IAT',20)
colorbar
grid minor
title(TTXT)
xlabel(XTXT)
ylabel(YTXT)
hold on
plot(XM,YM,'-
mo','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','w','MarkerFaceColor','b','marker
size',6);

```


ข.4 โปรแกรมเพื่อ Fitting ความเข้มแสงที่ได้จากการวัดเพื่อหาความหนาของฟิล์ม และ
คำนวณ Sensitivity ที่ได้จากความหนานั้น



รูปที่ ข.4 Flowchart ของโปรแกรมที่ ข.4

```

%===== BEGIN PROGRAM =====
clc
clear all
%===== INPUT PARAMETERS =====
fh = [0e-9:1e-9:500e-9]; % Flying height (Air gap)
WL = [450e-9, 550e-9, 650e-9]; % Wave length Red 650, green 550,
% blue 450
Mode = 1; % Measurement condition 1: AVG data
% of Si1/DLC77 (3Layers)
% 2: AVG data of 5Layers disk

FT_ON = 1; % Fitting loop ON = 1, OFF = 0
FT_S = 1; % Fit start and stop
FT_ST = 4;

PLD = 100; % PLOT display to this FH
SHF = 0; % Amount of FH shift of each point, minimum
% value can't lower than -19

DS1 = [60,80]; % Thickness range of DLC1
DS2 = [21,29]; % Thickness range of DLC2
SS1 = [0.5,1.2]; % Thickness range of Si1
SS2 = [2.5,3.5]; % Thickness range of Si2

SD = 1; % Step to vary DLC thickness for iteration loop
ST = 0.01; % Step to vary Si thickness for iteration loop
SC = 20; % Sensitivity cal Only 20 and 50 can be input

%=====
%=====
%===== DEFINE RELATION =====
%=====
if Mode == 1
    MEA = 1;
    DS2 = [1,1];
    SS2 = [1,1];
    fhm1(1) = 18.94;
    fhm1(2) = 44.6;
    fhm1(3) = 63;
    fhm1(4) = 83.2;
elseif Mode == 2
    MEA = 2;
    fhm2(1) = 16.09;
    fhm2(2) = 42.2;
    fhm2(3) = 60.6;
    fhm2(4) = 80.54;
end

%=====
%===== CALCULATION =====
%=====
mERR = 1000;
Iter = 0;
for di2 = DS2(1):SD:DS2(2)
    for Ti2 = SS2(1):ST:SS2(2)
        for di = DS1(1):SD:DS1(2)
            for Ti = SS1(1):ST:SS1(2)
                d = di*1e-9;
                T = Ti*1e-9;
                if Mode == 1
                    d2 = 0;

```

```

        T2 = 0;
    else
        d2 = di2*1e-9;
        T2 = Ti2*1e-9;
    end
    Iter = Iter+1;
for LC = 1:length(WL)
    L = WL(LC);
if L == 450e-9
    Ng = 1.54+0.02i;           % Glass
    Ns = 4.419+1.328i;        % Si amorphous
    Nd = 2.169+0.2087i;      % DLC
    Na = 1;                   % Air
    Nh = 2.39+0.432i;        % AlTiC
    if Mode == 1
        PT1(1) = 524.182;
        PT1(2) = 763.879;
        PT1(3) = 881.348;
        PT1(4) = 949.955;

        %=====
        PT1_min(1) = 223;
        PT1_min(2) = 226.4;
        PT1_min(3) = 213;
        PT1_min(4) = 212.4;

        %=====
        PT1_max(1) = 961.6;
        PT1_max(2) = 949;
        PT1_max(3) = 963.8;
        PT1_max(4) = 978.6;
    elseif Mode == 2
        PT2(1) = 719.313;
        PT2(2) = 978.59;
        PT2(3) = 1102.848;
        PT2(4) = 1140.988;

        %=====
        PT2_min(1) = 298.6;
        PT2_min(2) = 302.4;
        PT2_min(3) = 289.8;
        PT2_min(4) = 287.4;

        %=====
        PT2_max(1) = 1152.8;
        PT2_max(2) = 1131.4;
        PT2_max(3) = 1174.8;
        PT2_max(4) = 1160.6;
    end
end
elseif L == 550e-9
    Ng = 1.51+0.01i;           % Glass
    Ns = 4.232+0.634i;        % Si amorphous
    Nd = 2.1699+0.1416i;      % DLC
    Na = 1;                   % Air
    Nh = 2.354+0.363i;        % AlTiC
    if Mode == 1
        PT1(1) = 530.599;
        PT1(2) = 850;
        PT1(3) = 1058.223;
        PT1(4) = 1221.336;

        %=====
        PT1_min(1) = 298.4;
        PT1_min(2) = 283.2;
        PT1_min(3) = 280.8;
        PT1_min(4) = 271;
    end
end

```

```

%=====
    PT1_max(1) = 1378.4;
    PT1_max(2) = 1378.4;
    PT1_max(3) = 1378.6;
    PT1_max(4) = 1387.6;
elseif Mode == 2
    PT2(1) = 879.494;
    PT2(2) = 1350.186;
    PT2(3) = 1672.807;
    PT2(4) = 1901.923;
%=====
    PT2_min(1) = 434.6;
    PT2_min(2) = 428.8;
    PT2_min(3) = 406;
    PT2_min(4) = 398.8;
%=====
    PT2_max(1) = 2083;
    PT2_max(2) = 2069;
    PT2_max(3) = 2090;
    PT2_max(4) = 2086.8;
end
elseif L == 650e-9
    Ng = 1.52;
    Ns = 4.014+0.309i;
    Nd = 2.1631+0.0985i;
    Na = 1;
    Nh = 2.289+0.344i;
    if Mode == 1
        PT1(1) = 540.167;
        PT1(2) = 947.603;
        PT1(3) = 1262.077;
        PT1(4) = 1532.146;
%=====
        PT1_min(1) = 364;
        PT1_min(2) = 338.6;
        PT1_min(3) = 330.2;
        PT1_min(4) = 317;
%=====
        PT1_max(1) = 1961.6;
        PT1_max(2) = 1979.2;
        PT1_max(3) = 1971.2;
        PT1_max(4) = 1980.4;
    elseif Mode == 2
        PT2(1) = 970.224;
        PT2(2) = 1629.896;
        PT2(3) = 2133.666;
        PT2(4) = 2550.377;
%=====
        PT2_min(1) = 572.4;
        PT2_min(2) = 559.6;
        PT2_min(3) = 517.8;
        PT2_min(4) = 508.8;
%=====
        PT2_max(1) = 3188.6;
        PT2_max(2) = 3179.4;
        PT2_max(3) = 3206.6;
        PT2_max(4) = 3200.6;
    end
end
%=====
ASSIGN Rij,Tij
%=====

```

```

% Glass
% Si amorphous
% DLC
% Air
% AlTiC

```

```

=====
n = [Ng,      % Glass
     Ns,      % Si
     Nd,      % DLC
     Ns,      % Si2
     Nd,      % DLC2
     Na,      % Air
     Nh];     % AlTiC
for u = 1:length(n)
    for v = 1:length(n)
        r(u,v) = (n(u)-n(v))/(n(u)+n(v));
        t(u,v) = 2*n(u)/(n(u)+n(v));
    end
end
end

=====
%===== DEFINE 1st composite layer =====
%=====
%----DLC2----- 5
%----Air----- 6
%----AlTiC----- 7
    for u = 1:length(fh)
        Rdm = r(5,6); % Beam which reflect from middle layer
        Rdb = r(6,7); % Beam which reflect from bottom layer
        B = (2*pi*fh(u)*n(6))/L; % BETA, Below r of composite 1
        rc1(u,1) = (Rdm+Rdb*(exp(2*i*B)))/(1+Rdm*Rdb*(exp(2*i*B)));
    end
%=====
%===== DEFINE 2nd composite layer =====
%=====
%--Add layer2-- 4
%----DLC2----- 5
%----COMP1-----rc1
        A = (2*pi*d2*n(5))/L; % ALPHA, Below r of material
        Rdm = r(4,5); % Beam which reflect from middle layer
        Rdb = rc1(u,1); % Beam which reflect from bottom layer
        rc2(u,1) = (Rdm+Rdb*(exp(2*i*A)))/(1+Rdm*Rdb*(exp(2*i*A)));
%=====
%===== DEFINE 3rd composite layer =====
%=====
%----DLC1----- 3
%--Add layer2-- 4
%----COMP2-----rc2
        G = (2*pi*T2*n(4))/L; % ALPHA, Below r of material
        Rdm = r(3,4); % Beam which reflect from middle layer
        Rdb = rc2(u,1); % Beam which reflect from bottom layer
        rc3(u,1) = (Rdm+Rdb*(exp(2*i*G)))/(1+Rdm*Rdb*(exp(2*i*G)));
%=====
%===== DEFINE 4th composite layer =====
%=====
%--Add layer1--2
%----DLC1-----3
%----COMP2-----rc3
        O = (2*pi*d*n(3))/L; % ALPHA, Below r of material
        Rdm = r(2,3); % Beam which reflect from middle layer
        Rdb = rc3(u,1); % Beam which reflect from bottom layer
        rc4(u,1) = (Rdm+Rdb*(exp(2*i*O)))/(1+Rdm*Rdb*(exp(2*i*O)));
%=====
%===== DEFINE 5th composite layer =====
%=====
%----Glass----1
%--Add layer1--2

```

```

%-----COMP2-----rc4
    Q = (2*pi*T*n(2))/L; % ALPHA, Below r of material
    Rdm = r(1,2); % Beam which reflect from middle layer
    Rdb = rc4(u,1); % Beam which reflect from bottom layer
    rc5(u,1) = (Rdm+Rdb*(exp(2*i*Q)))/(1+Rdm*Rdb*(exp(2*i*Q)));
    Amp(u,1) = abs(rc5(u,1))^2;
    Phs(u,1) = angle(rc5(u,1));

end

%=====
%===== NORMALIZED INTENSITY TO 0-2 =====
%=====
    AmpN = Amp-min(Amp);
    mN = 2/max(AmpN);
    AmpC_N2 = AmpN.*mN;

%=====
%===== MEASUREMENT LOOP =====
%=====
% Use intensity from measurement from each case to re-plot FH
    if MEA == 1
        PT = PT1;
        PT_min = PT1_min;
        PT_max = PT1_max;
        fhm = fhml+SHF;
        MTXT = '1st';
    elseif MEA == 2
        PT = PT2;
        PT_min = PT2_min;
        PT_max = PT2_max;
        fhm = fhm2+SHF;
        MTXT = '2nd';
    elseif MEA == 0
        ac1 = 0;
        %==== Merge data from 1&2 measurement ====
        for a1 = 1:length(fhml)
            fhmd(a1,1) = fhml(a1);
            PTd(a1,1) = PT1(a1);
            PTd_min(a1,1) = PT1_min(a1);
            PTd_max(a1,1) = PT1_max(a1);
        end
        for a2 = length(fhml)+1:length(fhml)+length(fhm2)
            ac1 = ac1+1;
            fhmd(a2,1) = fhm2(ac1);
            PTd(a2,1) = PT2(ac1);
            PTd_min(a2,1) = PT2_min(ac1);
            PTd_max(a2,1) = PT2_max(ac1);
        end
    end
    %=====
    %==== Sort intensity data by assending fh ====
    fhmdS = sort(fhmd);
    for as = 1:length(fhmd)
        for as2 = 1:length(fhmd)
            if fhmdS(as) == fhmd(as2)
                A_index(as,1) = as2;
            end
        end
    end
    end
    %==== Define all necessary input parameters ====
    for Is = 1:length(fhmd)
        PT(Is,1) = PTd(A_index(Is));
        PT_min(Is,1) = PTd_min(A_index(Is));
        PT_max(Is,1) = PTd_max(A_index(Is));
    end

```

```

        end
        fhm = fhmdS+SHF;
        MTXT = 'ALL';
    end
    for m = 1:length(fhm)
        IP(m) = ((PT(m)-PT_min(m))/(PT_max(m)-PT_min(m)))*2;
        if IP(m) < 0
            IP(m) = 0;
        end
    end
    end
    if FT_ON == 0
        break, end
%=====
%===== FITTING LOOP =====
%=====
% Fit N&K which its intensity give nearest FH to measurement data
    CT = 0;
    Cf = 0;
    for u = FT_S:FT_ST
        CT = CT+1;
        mI = 200;
        for v = 1:round(max(fhm))+1+5
            Cf = Cf+1;
            fERR(Cf,1) = abs(AmpC_N2(v)-IP(u));
            if fERR(Cf,1)<mI
                mI = fERR(Cf,1);
                fhC = v-1;
            end
        end
        FHC(CT) = fhC; % Find the FH of each intensity which
nearest to measured intensity
    end
    Sfhm = size(fhm(FT_S:FT_ST));
    SFHC = size(FHC);
    if Sfhm(1,1) ~= SFHC(1,1)
        FHC = FHC';
    end
    ERR = sum((fhm(FT_S:FT_ST)-FHC).^2);
    if LC == 1
        ERR1 = ERR;
        nb = n;
        IPB = IP;
    elseif LC == 2
        ERR2 = ERR;
        ng = n;
        IPG = IP;
    elseif LC == 3
        ERR3 = ERR;
        nr = n;
        IPR = IP;
    end
    end

    end
    SERR = ERR1+ERR2+ERR3;
    if SERR< mERR
        mERR = SERR;
        Tindex = T;
        dindex = d;
        Tindex2 = T2;
        dindex2 = d2;
        FHC2 = FHC;
    end

```



```
        legend(['DLC = ',num2str(dindex*10^9),' nm ' , 'Si =  
' ,num2str(Tindex*10^9),' nm'])  
elseif Mode == 2  
    legend(['DLC1 = ',num2str(dindex*10^9),' nm, ' , 'Si1 =  
' ,num2str(Tindex*10^9),' nm, DLC2 = ',num2str(dindex2*10^9),' nm, Si2  
= ',num2str(Tindex2*10^9),' nm'])  
end  
ylabel('Normalized intensity')  
xlabel('FH(nm)')  
end  
END PROGRAM
```



ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายกรกช เพชรดี เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 และได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2551

